

令和5年度TIA連携プログラム調査研究課題(かけはし)  
「部分窒化無酸素無炭素チタン蒸着膜の産業応用に関する調査研究」  
キックオフミーティングの事前登録ログインページ

<https://kds.kek.jp/event/47677/>

の画面(下図参照)で『Access Key』欄の上部に表示されているアルファベットの単語をそのまま『Access Key』欄に入力して **Login** をクリックする。

KDS.kek.jp

A access key is required to browse the KDS pages

Type the access key what you see below.

ここに表示されているアルファベットを入力する

Access key:

Login

次の画面(下図参照)で右下の  をクリックする。

## 令和5年度 TIA連携プログラム調査研究課題 (かけはし) ミーティング

📅 Wednesday 23 Aug 2023, 13:30 → 16:30 Asia/Tokyo

📍 KEK

Description TIA連携プログラム調査研究(かけはし)ミーティング

「部分窒化無酸素無炭素チタン蒸着膜の産業応用に関する調査研究」

Zoomミーティングによるオンライン開催予定。

参加費：無料

事前登録ページ: [参加登録](#)

← ここはクリックしない

(Login画面で『Access Key』欄には、その上部に表示されているアルファベットを入力してください)

登録締め切り：8月23日(水) 12:00

問い合わせ先:間瀬一彦(KEK)、mase-at-post.kek.jp (-at-を@に置き換えてください)

ここをクリック



Registration

 [参加登録](#)



次の画面(下図参照)で姓、名、E-mailアドレス、所属機関、職名を入力して  をクリックする。